

高真空蒸着装置 RD-1300



高真空蒸着装置RD-1300は小型蒸着装置の水
晶振動式膜厚計搭載型抵抗加熱蒸着装置です。
研究機構向けに開発された本装置は、抵抗加熱
機構2対(切替式)を装備し、真空状態のまま多層
膜が可能です。また排気系は、ターボ分子ポン
プを採用しておりますので、短時間でクリーンな排
気が可能です。

本装置の排気系操作(真空排気及びベント)は自
動となっております。

高真空蒸着装置 RD-1300 仕様

- 到達圧力 1.0×10⁻⁴Pa以下※常温・無負荷時
- 排気速度 1.3×10⁻³Pa迄本引開始後10分以内※常温・無負荷時
- 真空漏洩量 1.0×10⁻¹⁰Pa・m³/sec Heリークデテクター検査
- 真空室径 φ230mm×275mmH 硬質ガラス
- 蒸着機構 抵抗加熱方式2対切替式(ポート)
AC10V0~100A
制御方式:スライダック制御
電流計・切替スイッチ
- 基板形状 最大でφ4インチ1枚固定可能
- 基板回転 基板回転数:0~15rpm
速度表示計付き
- 膜厚計 水晶振動式膜厚計
- 真空排気系 油回転ポンプ:100L/min[60Hz]
ターボ分子ポンプ:70L/sec
- 真空計 ピラニ真空計/電離真空計
- 操作方法 自動
- ユーティリティ電気:AC100V単相20A
冷却水:0.2L/min以上0.1MPaG以上0.15MPaG以下25℃以下循環
寸法:1100mmW×550mmD×1230mmH
- オプション ガス導入機構(マスフローコントローラ付)
他、多数のオプション付加&カスタマイズ可能

